

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成18年8月3日(2006.8.3)

【公開番号】特開2005-321746(P2005-321746A)

【公開日】平成17年11月17日(2005.11.17)

【年通号数】公開・登録公報2005-045

【出願番号】特願2004-210902(P2004-210902)

【国際特許分類】

<b>G 0 9 F</b>	<b>9/00</b>	<b>(2006.01)</b>
<b>B 3 2 B</b>	<b>7/02</b>	<b>(2006.01)</b>
<b>B 3 2 B</b>	<b>9/00</b>	<b>(2006.01)</b>
<b>H 0 1 J</b>	<b>11/02</b>	<b>(2006.01)</b>
<b>H 0 5 K</b>	<b>9/00</b>	<b>(2006.01)</b>

【F I】

<b>G 0 9 F</b>	<b>9/00</b>	<b>3 1 3</b>
<b>G 0 9 F</b>	<b>9/00</b>	<b>3 0 9 A</b>
<b>B 3 2 B</b>	<b>7/02</b>	<b>1 0 4</b>
<b>B 3 2 B</b>	<b>9/00</b>	<b>A</b>
<b>H 0 1 J</b>	<b>11/02</b>	<b>E</b>
<b>H 0 5 K</b>	<b>9/00</b>	<b>V</b>

【手続補正書】

【提出日】平成18年6月16日(2006.6.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0070

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0070】

(分析方法)

本発明における積層体の分析手法は以下の通りである。

積層体表面の原子組成は、オージェ電子分光法(AES)、蛍光X線法(XRF)、X線マイクロアナライシス法(XMA)、ラザフォード後方散乱分析法(RBS)、X線光電子分光法(XPS)、真空紫外光電子分光法(UPS)、赤外吸収分光法(IRR)、ラマン分光法、2次イオン質量分析法(SIMS)、低エネルギーイオン散乱分光法(ISS)等により測定できる。また、積層体中の原子組成及び膜厚は、X線光電子分光法(XPS)やオージェ電子分光法(AES)や2次イオン質量分析(SIMS)を深さ方向に実施することによって調べることができる。

積層体の構成及び各層の状態は断面の光学顕微鏡測定、走査型電子顕微鏡(SEM)測定、透過型電子顕微鏡測定(TEM)を用いて調べることができる。